МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Актуализировано: на заседании кафедры протокол от «20» июня 2017 г. №7 Зав. кафедрой / Салихов Р.Б	Согласовано: Председатель УМК ФТИ
4000	/ <u>Балапанов М.Х.</u>
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Д	(ИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	ПЛАЗМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ание дисциплины)
Базовая	дисциплина
(Цикл дисциплины и его часть (база	овая, вариативная, дисциплина по выбору))
11.03.04 электроника	и и наноэлектроника,
(указывается код и наименование нап	равления подготовки (специальности))
Направленность (пр	оофиль) подготовки
	иборы и устройства»
(указывается наименование напра	вленности (профиля) подготовки)
Квалиф	рикация
	лавр
(указывается	квалификация)
Разработчик (составитель) профессор, д.фм.н.,	
(должность, ученая степень, ученое звание)	/ Юмагузин Ю.М.
	/_ Юмагузин Ю.IVI. (подпись, Фамилия И.О.)
п	2015

Для приема: 2015 г. Уфа 2017г. Составитель / составители: д.ф.-м.н., профессор Юмагузин Ю.М.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на заседании кафедры инфокоммуникационных технологий и наноэлектроники протокол от «20» июня 2017 г. №7

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры инфокоммуникационных технологий и наноэлектроники, протокол № 7 от «05» июня $2018~\Gamma$.

Заведующий кафедрой

/ <u>Салихов Р.Б.</u>

Список документов и материалов (оглавление)

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенны планируемыми результатами освоения образовательной программы	ых с
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учеб занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающи - (Приложение №1)	6 (21)
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	7
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в пропосвоения образовательной программы. Описание показателей и крите	7
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание и оценивания	шкал
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оц-	енки
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих эт формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формиров компетенций	ений,
4.3. Рейтинг-план дисциплины (Приложение №2)	11(25)
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	18
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой освоения дисциплины	і для 18
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернепрограммного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	ет» и 18
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь процесса по дисциплине	ного 19

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

При изучении дисциплины <u>«Вакуумная и плазменная электроника»</u> у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования;

Для формирования указанных компетенций и освоения образовательной программы обучающийся должен показать следующие результаты обучения по дисциплине:

	Результаты обучения	Формируемая	Примечание
		компетенция (с	
		указанием кода)	
Знания	Знать электронную эмиссию: основы		Явления различных
	электронной теории твердого тела,		видов эмиссии
	термоэлектронная, автоэлектронная,	ОПК-7,	электронов широко
	взрывная, вторично-электронная,	ПК-1	применяются в
	фотоэлектронная эмиссия;		электронной технике.
	электронный поток, его формирование		Электронное строение
	и транспортировка: интенсивные и		определяет химические
	неинтенсивные, релятивистские и		свойства - современные
	нерелятивистские электронные потоки;		концепции химии.
	способы формирования электронных		
	потоков различной интенсивности		
	(электронные пушки и прожекторы),		
	транспортировка электронного потока		
	и способы ограничения его		
	поперечных размеров; примеры		
	использования в приборах вакуумной		
	электроники; модели для описания		
	свойств плазмы; типы газовых		
	разрядов; общие свойства плазмы:		
	явления переноса, плазма в магнитном		
	поле, колебания, неустойчивости и		
	эмиссионные свойства плазмы,		
	излучение плазмы		

темам; управление электронными потоками: электрические и магнитные способы управления плотностью и скоростью электронов; квазистатические и динамические способы управления; примеры использования в приборах вакуумной электроники; ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на (навыки / электромагнитиыми полями, деятельно эпертетический эффект сти) взаимодействии с внешними и структурами, эффекты взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;	Умения	Уметь решать задачи по основным		Туннельный эффект,
потоками: электрические и магнитные способы управления плотностью и скоростью электронов; квазистатические и динамические способы управления; примеры использования в приборах вакуумной электроники; ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на взаимодействии с внешними электромагнитными полями, деятельно сти) взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;	у міспих			11 -
способы управления плотностью и скоростью электронов; квазистатические и динамические способы управления; примеры использования в приборах вакуумной электроники; ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на взаимодействии с внешниии электромагнитными полями, оне взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия с твердыми телами и структурами, эффект ости) взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		, , , 1		± ± ′
скоростью электронов; квазистатические и динамические способы управления; примеры использования в приборах вакуумной электроники; ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на взаимодействии с внешними электромагнитными полями, энергетический эффект сти) взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменых потоков; диагностика параметров плазмы;		-	ОПК-7 ПК-1	
квазистатические и динамические способы управления; примеры использования в приборах вакуумной электроники; ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на (навыки / опыт электромагнитными полями, деятельно сти) взаимодействии с внешними и структурами, эффекты взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		1	OHK-7, HK-1	
способы управления; примеры использования в приборах вакуумной электроники; ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на (навыки / опыт электромагнитными полями, деятельно ети взаимодействия с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		1 - 1		<u> </u>
использования в приборах вакуумной электроники; ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на (навыки / взаимодействии с внешними электромагнитными полями, деятельно сти) взаимодействий; способы, основанные на взаимодействий с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		1		
электроники; ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения (навыки / опыт электромагнитными полями, энергетический эффект взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;				
плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения (навыки / опыт электромагнитными полями, энергетический эффект взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;				
плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на (навыки / взаимодействии с внешними опыт электромагнитными полями, деятельно энергетический эффект сти) взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		1		
поверхностях; основные методы генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на (навыки / взаимодействии с внешними электромагнитными полями, деятельно энергетический эффект опк-7, ПК-1 взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		1		-
генерации плазмы; Владения Владение способами, основанные на (навыки / взаимодействии с внешними опыт электромагнитными полями, деятельно энергетический эффект сти) взаимодействия; способы, основанные на взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		<u> </u>		
Владения Владение способами, основанные на (навыки / взаимодействии с внешними опыт электромагнитными полями, деятельно энергетический эффект сти) взаимодействия; способы, основанные на взаимодействия с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		1 1		естественных наук
(навыки / взаимодействии с внешними электромагнитными полями, энергетический эффект опк-7, ПК-1 взаимодействия; способы, основанные на взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;	-	1		
опыт электромагнитными полями, энергетический эффект опк-7, Пк-1 взаимодействия; способы, основанные на взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;				
реятельно энергетический эффект опк-7, ПК-1 взаимодействия; способы, основанные на взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; опк-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;	(навыки /			
взаимодействия; способы, основанные на взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; ОПК-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;	опыт	± 1		
на взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; ОПК-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		1	ОПК-7, ПК-1	
и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминисценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; ОПК-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;	сти)	, ,		
взаимодействия (катодолюминисцен- ция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; ОПК-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		*		
ция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; ОПК-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		15 51 , 11		
излучение, нагрев); Примеры использования в приборах вакуумной электроники; ОПК-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		взаимодействия (катодолюминисцен-		
Примеры использования в приборах вакуумной электроники; ОПК-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		ция, катодоусиление, рентгеновское		
вакуумной электроники; ОПК-7, ПК-1 преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		излучение, нагрев);		
преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		Примеры использования в приборах		
потока в другие виды энергии: методы ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		вакуумной электроники;	ОПК-7, ПК-1	
ускорения плазменных потоков; диагностика параметров плазмы;		преобразование энергии электронного		
диагностика параметров плазмы;		потока в другие виды энергии: методы		
		ускорения плазменных потоков;		
примананна плазми в элактронника		диагностика параметров плазмы;		
применение плазмы в электронике		применение плазмы в электронике		

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Вакуумная и плазменная электроника» относится к *обязательной* части рабочего учебного плана.

Дисциплина изучается на <u>3 курсе</u> в <u>5</u> семестре.

Целью данной дисциплины является выработка у студентов корректных представлений об особенности эмиссии электронов, протекание тока в газах, вакууме и твердом теле.. В итоге у студента должно сложиться представление о формирования и транспортировки электронных лучей, взаимодействия их с твердыми телами и структурами, преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии.

Дисциплина «Вакуумная и плазменная электроника» заканчивает цикл дисциплин «Общая физика», в которых рассматриваются, в основном, классические представления физики, и начинает ознакомление с результатами физических экспериментов и теоретическими представлениями в области квантовой теории о свойствах микрообъектов и материи в целом.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, предварительно сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, физический практикум, математический анализ.

Чтобы приступить к изучению дисциплины «Вакуумная и плазменная электроника» студент должен знать основные понятия и законы перечисленных выше дисциплин, уметь находить производные функций и их пределы, иметь навыки нахождения неопределенных и

определенных интегралов функций. Студент должен иметь представления об основных средствах измерений в лабораторном физическом практикуме, уметь пользоваться измерительными приборами в рамках лабораторного физического практикума, иметь навыки расчетов погрешностей прямых и косвенных измерений.

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код и формулировка компетенции

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

Этап	Планируемые результаты	Критерии оцен	ивания резу	льтатов о	бучения
(уровень)	обучения	2	3	4	5
освоения	(показатели достижения	«He	«Удовлет	-	«Отлично
компетенци	31	удовлетворитель	ворительн	0»	»
И	компетенций)	но»	0>>		
Первый	знать основы электронной	не знает	обладает	обладае	знает
этап	теории твердого тела,	элементарных и	элемента	T	элемента
(начальный	термоэлектронная,	современных	рных и	знание	рных и
уровень)	автоэлектронная, взрывная,	-	современ	M	современ
	вторично-электронная,	электроники	ных	элемент	
	фотоэлектронная эмиссия;		проблем	арных	проблем
	электронный поток, его		электрон	И	электрон
	формирование и транс-		ИКИ	соврем	ики
	портировка: интенсивные и			енных	
	неинтенсивные, релятиви-			пробле	
	стские и нерелятивистские			M	
	электронные потоки; способы			электро	
	формирования электронных			ники за	
	потоков различной			исключ	
	интенсивности; элементар-			ением	
	ные процессы в плазме и на			некотор	
	пограничных поверхностях;			ЫХ	
	основные методы генерации				
	плазмы; модели для описания				
	свойств плазмы; типы				
	газовых разрядов; общие				
	свойства плазмы: явления				
	переноса, плазма в				
	магнитном поле, колебания,				

		I		
неустойчивости и эмиссион-				
+				
	-	-	-	умеет
1 1	-	_	применя	применят
	основы знаний		ТЬ	ь основы
	для	знаний	основы	знаний
<u>.</u>	представления	для	знаний	для
способы управления	применения	представл	для	представл
плотностью и скоростью	основ	ения	предстан	ения
электронов; квазистатические	электроники	применен	ления	применен
и динамические способы		ия основ	примене	ия основ
управления; примеры		электрони	ния	электрони
использования в приборах		ки	основ	ки
вакуумной электроники;		-	электрог	
преобразование энергии			ики	
электронного потока в другие				
виды энергии:				
Владеть основными	не владеет	владеет	владеет	.владеет
способами, основанные на	знаниями о	знаниями	знаниям	знаниями
взаимодействии с внешними	взаимодействии	O	ио	O
электромагнитными полями,	внешних полей	взаимоде	взаимод	взаимоде
энергетический эффект	электронов, нет	йствии	ействии	йствии
взаимодействия; способами ,	представления о	внешних	внешних	внешних
основанные на	плазме.	полей	полей	полей
взаимодействии с твердыми		электронс	электрог	электронс
гелами и структурами,		в, нет	ов, нет	в, нет
оффекты взаимодействия		представл	предстан	представл
методы генерации плазмы;		ения о	ления о	ения о
моделями для описания		плазме.	плазме.	плазме.
свойств плазмы; типы газовых			В	
разрядов;				
	риборах вакуумной лектроники; управление лектронными потоками: лектрические и магнитные пособы управления лотностью и скоростью лектронов; квазистатические динамические способы правления; примеры спользования в приборах акуумной электроники; реобразование энергии лектронного потока в другие иды энергии: Владеть основными пособами, основанные на заимодействии с внешними лектромагнитными полями, нергетический эффект заимодействия; способами , снованные на заимодействии с твердыми елами и структурами, ффекты взаимодействия и структурами, ффекты взаимодействия плазмы; поделями для описания войств плазмы; типы газовых	римеры использования в риборах вакуумной лектроники; управление лектронными потоками: для представления пособы управления применения основ лектронов; квазистатические динамические способы правления; примеры спользования в приборах акуумной электроники; реобразование энергии лектронного потока в другие иды энергии: Владеть основными полями, нергетический эффект заимодействии с внешними лектромагнитными полями, нергетический эффект заимодействия; способами , основанные на заимодействии с твердыми елами и структурами, ффекты взаимодействия втоды генерации плазмы; годелями для описания войств плазмы; типы газовых	римеры использования в риборах вакуумной применять применять основы знаний ваний для представления применения представления представления применения представления применения представления представления применения основ ения применения основ динамические способы правления; примеры спользования в приборах акуумной электроники; реобразование энергии лектронного потока в другие иды энергии: Владеть основными не владеет знаниями о взаимодействии с внешними лектромагнитными полями, нергетический эффект заимодействия; способами , снованные на заимодействия; способами , плазме. Владеть основными полями, внешних полей электронов, нет представления о плазме. Владеть пособами доветнительной рактронов, нет представления о плазме. Владеть пособами доветнительной рактронов, нет представления о плазме. Владеть представления о плазме. Владеть представления о плазме. Владеть представления о плазме. Владеть представления о плазме.	римеры использования в не умеет применят применя

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования;

Этап	Планируемые результаты обучения	Критер	ии оценива	ния резул	ьтатов
(уровень)	(показатели достижения заданного	го обучения			
освоения	уровня освоения компетенций)	2	3	1	5
компетенци		«Не	«Удовлет	4 Voneyy	,(Ommyyyy
И		удовлетво	ворительн	«Хорош	
		рительно»	0>>	0>>	0>>
Первый	знать основы электронной теории	не знает	обладает	обладае	знает
этап	твердого тела, термоэлектронная,	элемента	элемента	T	элемент
(начальный	автоэлектронная, взрывная,	рных и	рных и	знание	арных и
уровень)	вторично-электронная,	современ	современ	M	совреме
	фотоэлектронная эмиссия;	ных	ных	элемент	нных
	электронный поток, его	проблем	проблем	арных	пробле
	формирование и транспортировка:	электрон	электрон	И	M
	интенсивные и неинтенсивные,	ики	ики	соврем	электро
	релятивистские и нерелятивистские			енных	ники

	электронные потоки; способы			пробле	
	формирования электронных потоков			M	
	различной интенсивности			электро	
	(электронные пушки и прожекторы),			ники за	
	транспортировка электронного			исключ	
	потока и способы ограничения его			ением	
	поперечных размеров; примеры			некотор	
	использования в приборах			ЫХ	
	вакуумной электроники; управление				
	электронными потоками:				
	электрические и магнитные способы				
	управления плотностью и скоростью				
	электронов;				
Второй	Уметь управлять электронными	не умеет	умеет	умеет	умеет
-	потоками: электрические и	применят	•	применя	-
	магнитные способы управления	ь основы	ь основы	ТЬ	ТЬ
`	плотностью и скоростью электронов;	знаний	знаний	основы	основы
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	квазистатические и динамические	для	для	знаний	знаний
	способы управления; примеры	представл		для	для
	использования в приборах вакуумной	ения	ения	предстан	
	электроники; преобразование		применен	_	ления
	энергии электронного потока в	ия основ	ия основ	примене	
	другие виды энергии: способы,	электрони		ния	ния
	основанные на взаимодействии с	улсктрони КИ	улсктрони КИ	ОСНОВ	ОСНОВ
	внешними электромагнитными	КИ	КИ		
			•	электрон ики	электрон ики
	, 1			ики	ики
	взаимодействия;	***			
Третий этап		не	владеет	владеет	владеет
`	динамические способами	владеет	знаниями	знаниям	знаниям
	управления; примеры использования	знаниями	0	ИО	ИО
	в приборах вакуумной электроники;	0	взаимоде		взаимоде
		взаимоде		ействии	
	электронного потока в другие виды	йствии	внешних	внешних	
	энергии: способы, основанные на	внешних	полей	полей	полей
	взаимодействии с внешними	полей	электроно	электрон	-
	электромагнитными полями,	электроно		ов, нет	ов, нет
	энергетический эффект взаимо-	в, нет	представл	-	-
	действия; способы, основанные на	представл	ения о	ления о	ления о
	взаимодействии с твердыми телами и	ения о	плазме.	плазме.	плазме.
	структурами.	плазме.		В	

Показатели сформированности компетенции:

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины (*для экзамена:* текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный контроль – максимум 30 баллов, поощрительные баллы – максимум 10).

Шкалы оценивания:

```
(для экзамена:
```

от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»;

от 60 до 79 баллов – «хорошо»;

от 80 баллов – «отлично».

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этапн	и Результаты обучения	Компетенция	Оценочные средства
освоени	я		
1-й этап	знать основы электронной теории		
	твердого тела, термоэлектронная,		
Знания	автоэлектронная, взрывная, вторично-		
	электронная, фотоэлектронная		
	эмиссия; электронный поток, его		
	формирование и транспортировка:		
	интенсивные и неинтенсивные,	ОПК-7, ПК-1	Выполнение и защита
	релятивистские и нерелятивистские		отчета по лабораторным
	электронные потоки; способы		работам, тест, контрольная
	формирования электронных потоков		работа
	различной интенсивности		
	(электронные пушки и прожекторы),		
	транспортировка электронного потока		
	и способы ограничения его поперечных		
	размеров; примеры использования в		
	приборах вакуумной электроники;		
	ионизованный газ и плазма;		
	элементарные процессы в плазме и на		
	пограничных поверхностях; основные		
	методы генерации плазмы; модели для		
	описания свойств плазмы; типы газо-		
	вых разрядов; общие свойства плазмы:		
	явления переноса, плазма в магнитном		
	поле, колебания, неустойчивости и		
	эмиссионные свойства плазмы,		
	излучение плазмы		
2-й этап	Уметь управлять электронными	1	
	потоками: электрические и магнитные		
Умения	способы управления плотностью и	1	Выполнение и защита
	скоростью электронов; квазистати		отчета по лабораторным
	ческие и динамические способы	ιΟΠΚ-7, ПК-1	работам
	управления; примеры использования і	3	Контрольная работа
	приборах вакуумной электроники	-	Тест
	преобразование энергии электронного		
	потока в другие виды энергии	:	
	способы, основанные на	a l	
	взаимодействии с внешними	1	
	электромагнитными полями, энерге	-	
	тический эффект взаимодействия;		

3-й этап	Владеть способами, основанные на	
	взаимодействии с внешними	
Владеть	электромагнитными полями,	Выполнение и защита
навыками	энергетический эффект	отчета по лабораторным
	взаимодействия; способы, основанные ОПК-7, ПК-1	работам
	на взаимодействии с твердыми телами	Контрольная работа, тест
	и структурами, эффекты	
	взаимодействия (катодолюмини-	
	сценция, катодоусиление,	
	рентгеновское излучение, нагрев);	
	примеры использования в приборах	
	вакуумной электроники;	
	ионизованный газ и плазма;	
	элементарные процессы в плазме и на	
	пограничных поверхностях	

4.3 Рейтинг-план дисциплины

Рейтинг-план дисциплины представлен в приложении 2.

Экзаменационные билеты

Экзамен является оценочным средством для всех этапов освоения компетенций.

Структура экзаменационного билета:

Билет состоит из двух теоретических вопросов.

Примерные вопросы для экзамена:

- 1. Особенности газовой среды
- 2. Вакуум, степени вакуума, основной критерий степени.
- 3. Средняя длина свободного пробега частиц в газе.
- 4. Поверхностный потенциальный барьер.
- 5. Твердое тело, энергетическая диаграмма.
- 6. Энергия электронов в кристалле.
- 7. Плотность энергетических уровней в металле, заполнение уровней.
- 8. Электрические свойства твердых тел.
- 9. Термоэлектронная эмиссия.
- 10. Одномерная энергетическая диаграмма катодов.
- 11. Влияние внешнего ускоряющего поля на термоэмиссию, эффект Шоттки.

Образец экзаменационного билета:

Приведен в приложении 3.

Перевод оценки из 100-балльной в четырехбалльную производится следующим образом:

- отлично от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов);
- хорошо от 60 до 79 баллов;
- удовлетворительно от 45 до 59 баллов;
- неудовлетворительно менее 45 баллов.

Критерии оценки (в баллах):

- 25-30 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок;
- <u>17-24</u> баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки;
- 10-16 баллов выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;
- <u>1-10</u> баллов выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

Задания для контрольных работ

Описание контрольной работы №1:

Контрольная состоит из вопросов и задачи. Время выполнения – 45 минут.

Пример варианта контрольной работы №1:

... Вариант 2.

- 1. Назовите основные свойства электрона.
- 2. На что расходуется энергия кванта света при фотоэмиссии.
- 3. Назовите основные параметры термокатодов.
- 4. Что представляет из себя фотоэлементы? Какие факторы ограничивают предел линейности вольт-амперной характеристик фотоэлемента?

Задача.

Эмиссия катода, работающего при 2100 К, через некоторое время снижается на 10%. До какой величины нужно повысить напряженность электрического поля у катода для достижения первоначального уровня эмиссии, если исходное поле составляет 10^4 В/м?

Описание контрольной работы №2:

Контрольная состоит из вопросов и задачи, время выполнения – 45 минут.

Пример варианта контрольной работы №2:

Вариант №3

- 1. Объясните связь энергии электрона с ускоряющим напряжением.
- 2. Запишите и проведите анализ уравнения Ричардсона-Дешмана.

- 3. Как связан квантовый выход фотокатода с его спектральной чувствительностью?
- 4. Какой металл торий или вольфрам способен дать большую плотность тока термоэмиссии?

Залача.

Фоточувствительная поверхность имеет работу выхода 5 эВ. Какова граничная частота фотоэффекта? Какова энергия покидающих катод электронов, если поверхность облучается светом с длиной волны 220 нм?

Критерии оценивания задач контрольных работ:

- 5 баллов выставляется студенту, если задача решена абсолютно верно;
- 4 балла выставляется студенту, если при верном решении в общем виде допущена ошибка в числовых расчетах или при правильном ответе опущены некоторые промежуточные этапы решения или допущена непринципиальная ошибка в исходных уравнениях;
- 3 балла выставляется студенту, если отсутствует одно из необходимых исходных уравнений или допущена принципиальная ошибка в исходных уравнениях, но присутствуют правильные рассуждения и действия, направленные на получение ответа(задача решена наполовину);
- 1-2 балла выставляется студенту, если верно записана только часть необходимых исходных уравнений, при этом отсутствуют какие-либо математические преобразования, направленные на получение ответа или они ошибочны.

0 баллов ставится при отсутствии ответа или при полностью неверном ответ или когда ответ не соответствует условию задачи.

Задания для проведения тестов Модуль 1. Вакуумная электроника

При движении электрона в магнитном поле:

- 1. траектория движения не изменяется
- 2. траектория движения изменяется
- 3. энергия электрона изменяется

Волновые свойства электрона проявляются, если его движение ограничено областью пространства, линейные размеры которого по отношению к длине волны Де-Бройля электрона

- 1. много меньше
- 2. соизмеримы
- 3. много больше

Для нахождения энергии уровня Ферми в металле необходимо знать:

- 1. концентрацию электронов в металле
- 2. работу выхода электронов из металла
- 3. среднюю энергию электронов в металле

С увеличением работы выхода электронов из металла плотность термоэлектронного тока:

- 1. линейно возрастает
- 2. увеличивается экспоненциально
- 3. уменьшается

Фотоэлектронная эмиссия - это испускание электронов под действием

- 1. нагревания
- 2. электрического поля

3. электромагнитного излучения

Критерии оценки (в баллах) За каждый правильный ответ- 2 балл

Темы лабораторных работ

Лабораторная работа №1. «Фотоэлектронная эмиссия» Лабораторная работа №2. «Автоэлектронная эмиссия»

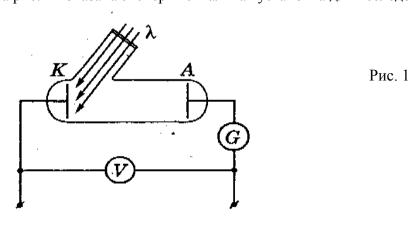
Пример лабораторной работы:
Лабораторная работа 1
«Фотоэлектронная эмиссия»

1.Основные понятия

В 1887 г. Герц обнаружил, что при освещении ультрафиолетовыми лучами отрицательно заряженного металлического тела оно теряет отрицательный заряд. При освещении такими же лучами положительно заряженного тела потери заряда нет. Если тело не было заряжено, то при освещении оно заряжается положительно до потенциала в несколько вольт. После открытия Томсоном электрона в 1897 г. было доказано, что при освещении тела теряют электроны.

Явление вырывания электронов из вещества при освещении его светом получило название фотоэлектрического эффекта или фотоэффекта. Электроны, вырванные под действием света, называются фотоэлектрическими свойствами обладают как металлы, так и диэлектрики, а также полупроводники и электролиты. Фотоэлектрический эффект вызывается не только ультрафиолетовыми лучами. Щелочные металлы: литий, натрий, калий, рубидий, цезий – весьма чувствительны к фотоэлектрическому действию и в видимой части спектра.

На рис. 1 показана экспериментальная установка для исследования фотоэффекта.



Фотоэлектроны, вырванные при освещении из катода К, увлекаются электрическим полем к замыкают По показаниям гальванометра G можно определить силу электрического тока в цепи, а с ней И количество фотоэлектронов, достигающих анода единицу времени. Ha I представлена зависимость рис. силы фототока ОТ разности U потенциалов И между катодом анодом.

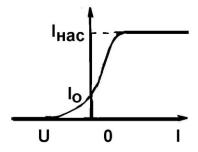


Рис. 2

При положительных значениях разности потенциалов электроны ускоряются от катода к аноду, при отрицательных – их ускорение происходит в обратном направлении. При нулевой разности потенциалов имеется поток электронов от катода к аноду. Это означает, что выбиваемые из катода электроны покидают поверхность катода с некоторой скоростью и благодаря этому достигают анода. Для их остановки и прекращения фототока необходимо приложить тормозящую разность потенциалов U₀. При увеличении разности потенциалов фототок увеличивается и стремится к току насыщения Інас. Насыщение достигается тогда, когда все электроны, вырываемые светом с поверхности катода в единицу времени, попадают на за же время. анод то Дальнейшее повышение разности потенциалов не меняет силу фототока: она определяется только количеством ежесекундно вырываемых электронов. Существование тока насыщения было установлено А.Г. Столетовым. Им же было доказано на опыте, что ток насыщения Інас строго пропорционален мощности светового потока падающего света Р, если только частота его остается постоянной (рис. 3).

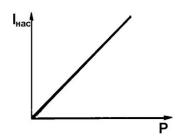


Рис. 3

Качественная картина механизма фотоэффекта с корпускулярной точки зрения такова: фотон, поглощаясь, отдает свою энергию электрону, и если эта энергия достаточна для того, чтобы освободить электрон от удерживающих его связей, то он выходит за пределы поверхности металла. Так как вероятность одновременного поглощения двух фотонов одним электроном ничтожно мала, то каждый освобожденный электрон заимствуем свою энергию у одного фотона. Поэтому число освобожденных фотоэлектронов должно быть пропорционально числу поглощенных фотонов, т.е. пропорционально интенсивности света (закон

Тормозящая разность потенциалов U_o от интенсивности света не зависит, зато зависит от частот падающего света ω . (рис. 4).

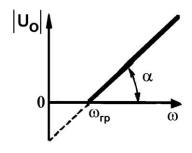


Рис. 4

Энергетический баланс при поглощении фотона может быть выражен следующим простым уравнением, которое обычно называется уравнением Эйнштейна:



где — энергия падающего фотона, A – работа выхода электрона из металла, кинетическая энергия электрона, покинувшего металл.

Из уравнения Эйнштейна вытекают следующие положения:

1. Электроны покидают поверхность металла с энергией от нуля до максимальной которая не зависит от интенсивности светового потока падающего света и линейно зависит от частоты падающего света.

Интенсивность света оказывает влияние только на количество вырванных электронов, но совсем не влияет на их максимальную кинетическую энергию.

2. Существует граничная частота ниже которой для данного металла фотоэффект отсутствует, независимо от интенсивности света и продолжительности облучения. (рис. 5).



Рис 5

Полученная электроном энергия частично затрачивается на освобождение из металла. Минимальную энергию, необходимую для освобождения электрона из металла, т.е. для преодоления потенциального барьера, называют работой выхода А. Очевидно, что если (А= при =0), которая ещё способна вызвать фотоэффект (красная граница

В таблице дается несколько примеров величины работы выхода.

Металл	Li	Na	K	Ca	W	Pd	Pt
Работа выхода, эВ	2,38	2,35	2,22	1,81	4,54	4,8	5,32

Зная работу выхода, можно вычислить длину волны красной границы фотоэффекта



Такие вычисления показывают, что для щелочных металлов пежит в видимой части спектра (для калия =0,6мкм), а для вольфрама, платины и других металлов с работой

выхода порядка 5-6 эВ – в ультрафиолете (для вольфрама =0,27 мкм).

Значения для некоторых металлов приведены в таблице.

Металл	Cs	Na	Zn	Ag	Pt
, MKM	0,60	0,53	0,33	0,28	0,20

Из уравнений (1) и (2) можно определить максимальную кинетическую энергию электрона:



Электроны, покинувшие поверхность металла с максимальной скоростью теряют эту скорость при тормозящем потенциале U_0 :



где q – заряд электрона.

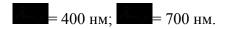
Из (3) и (4) получим выражение для тормозящей разности потенциалов в зависимости от частоты падающего света:

$$U_0 = (1000)(5)$$

Эта зависимость проиллюстрирована на рис. 4.

2. Порядок выполнения работы

- 1. Установите на монохроматоре входную щель— 1,0 мм, выходные щели на задний и боковые выходы— 3,0 мм.
- 2. Включите сетевую вилку в розетку.
- 3. Включите тумблер "сеть", при этом загорается красная лампа.
- 4. Включите источник света лампу накаливания с помощью тумблера "ЛН".
- 5. Установите тумблер "регулятор тока" в положение "макс".
- 6. Наблюдая изображение источника света через зрительную трубу, сфокусируйте излучение на входной щели с помощью поворотного зеркала входной оптики. При этом рукоятка управления решеткой должна быть утоплена.



7. Убедитесь в изменении цвета выходящего излучения при вращении ручки настройки монохроматора.

- 8. Определите минимальную и максимальную длину волны излучения, воспринимаемого визуально.
- 9. Выдвиньте рукоятку управления решеткой до упора, при этом поток излучения переключается на задний выход монохроматора.
- 10. Ручкой настройки монохроматора установите длину волны = 600 нм.
- 11. Поставьте лист белой бумаги к заднему выходу монохроматора и визуально убедитесь в наличии светового потока.
- 12. Установите фотоприемник ФЭУ на задний выход монохроматора.
- 13. Подключите ФЭУ к входу "ФП".
- 14. Подключите мультиметры к выходам измерительной системы.

Правый мультиметр (вольтметр), служащий для измерения напряжения на фотоприемнике, подключается к гнездам " $U_{\phi n}$ ". При этом красный провод-щуп подключается на мультиметре к разъему "V, "та на панели к верхнему гнезду " $U_{\phi n}$ ". Черный провод-щуп подключается на мультиметре к разъему "COM", а на панели к нижнему гнезду " $U_{\phi n}$ ".

- 15. Левый мультиметр (амперметр), служащий для измерения тока фотоприемника, подключается к гнездам " $I_{\phi \pi}$ " (выход усилителя фототока). При этом красный проводщуп подключается на мультиметре к разъему " $V_{,}$, MA", а на панели к нижнему гнезду " $I_{\phi \pi}$ ". Черный провод-щуп подключается на мультиметре к разъему "COM", а на панели к верхнему гнезду " $I_{\phi \pi}$ ".
- 16. На правом мультиметре установите переключатель пределов измерений на требуемую шкалу для функции DCV (измерение постоянного напряжения). Если измеряемое напряжение(шкала 20) заранее неизвестно, установите переключатель на наивысший предел, а затем уменьшайте до тех пор, пока не получите необходимую точность измерений. На дисплее мультиметра высвечиваются полярность и величина измеряемого напряжения.

Регулировка напряжения производится с помощью двух тумблеров $U_{\varphi \pi}$ на панели. Верхний тумблер $U_{\varphi \pi}$ позволяет регулиро-вать напряжение в пределах $0 \le U \le 20$ (В) (грубо). Нижний тумблер $U_{\varphi \pi}$ позволяет регулировать напряжение в пределах $-2 \le U \le 0$ (В) (плавно).

17. Ток фотоприемника (шкала 200m) I_{ϕ} пропорционален напряжению на выходе " $I_{\phi n}$ " с коэффициентом преобразования усилителя k. Этот коэффициент установите равным на шкале переключателя "... Тогда фототок

$$I_{\phi\pi} = k (U_{\phi\pi} - U_{\text{темн}}), (6)$$

где $U_{\varphi \pi}$ – напряжение на выходе усилителя (гнезда " $I_{\varphi \pi}$ ")

 $U_{\text{темн}}$ – напряжение на выходе усилителя при перекрытом световом потоке.

18. Для измерения $U_{\text{темн}}$ закрыть с помощью экрана-заглушки свет от источника. Выставить напряжение $U_{\phi \Pi} = 0$ (В). При этом напряжении снять показания $U_{\text{темн}}$. Например, для $U_{\text{темн}} = 0,1$ (В), $I_{\phi}(0) = k \cdot U_{\text{темн}} = 0,1$ (Такажа) $\cdot 0,1$ (В) $= 10^{-2}$ (мкА) $= 10^{-8}$ (А).

Критерии оценки (в баллах)

Приведен полностью правильно оформленный отчет, включающий правильные ответы на контрольные вопросы, правильно решенные задания и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов
Дан правильно оформленный отчет, включающий правильные ответы на контрольные вопросы, но в решении заданий имеются один или несколько недостатков
Нет правильно оформленного отчета

4 балла

2 балл

6 баллов

Участие в конференциях, публикация статей

1. Публикация статей – 5 баллов

Критерии	Оценка (в баллах)					
Тип работы	Реферативная работа	0,1				
	Работа носит исследовательский характер	0,3				
	Работа является исследованием	0,6				
Использование известных	Не использует никаких данных	0				
данных и научных фактов	Автор использовал известные данные	0,4				
	Использованы уникальные научные данные	0,6				
Полнота цитируемой	Использован учебный материал	0,1				
литературы, ссылка на	Использованы специализированные издания	0,3				
ученых	Использованы интернет ресурсы	0,6				
Актуальность работы	Изучение вопроса не является актуальным	0				
	Представленная работа привлекает интерес своей актуальностью	0,4				
	Работа содержит научный характер	0,6				
Степень новизны	Работа не содержит ничего нового	0				
полученных результатов	В работе доказан уже установленный факт	0,4				
	В работе получены новые данные	0,6				

2. Участие в конференции- 5 баллов

Творческий подход к отбору и структурированию материала	-	1 балл
Новизна и самостоятельность при постановке проблемы	-	1 балл
Выступление не является простым чтением с экрана	-	1 балл
В выступлении дополняются и раскрываются ключевые момент	гы,	
представленные на слайдах -		1 балл
Во время выступления поддерживается зрительный контакт с		
аудиторией, речь отличается богатством интонаций	-	1 балл

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

- 1. Сушков Вакуумная электроника: Физико-технические основы.— СПб. [и др.]: Лань, 2004.— 462 с [В библ. БашГУ имеется 5 экз.]
- 2. Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. М.:Наука, 1966. 564с.
- 3. Протасова, Ю. С., Чувашев, С. Н. Основы плазменной электроники.— М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006 .— 632 с.

Дополнительная литература:

- 1. Светцов В.И. Вакуумная и плазменная электроника .— Иваново, 2003 .— 171с.
- 2. Гусев, В. Г., Гусев, Ю. М. Электроника .— М.: Высш. шк., 1982 .— 496 с.
- 3. Светцов, В. И., Рыбкин, В. В., Титов, В. А. и др. Физическая электроника и электронные приборы. Лабораторный практикум. Иваново, 2001.— 234 с

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

- 1. http://window.edu.ru/resource/528/69528/files/vpe.pdf
- 2. https://studfiles.net/preview/1007673/
- 3. https://www.twirpx.com/files/radioelectronics/components/electrovacuum/vacuum_p lasma/

4	Электронно- библиотечная система «ЭБ БашГУ»	электронных изданий, которая	доступ по паролю из любой точки сети Интернет	БашГУ, дальнейший доступ из любой точки сети Интернет	https://elib.bashedu.ru/
5	«Университетская	учебных и научных	Авторизованный доступ по паролю из	Регистрация из сети БашГУ, дальнейший доступ из любой точки сети Интернет	
6	изпатель стра	лиебилу и паминту	Авторизованный доступ по паролю из	раші У,	http://e.lanbook.com/

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по лисциплине приведена в таблице:

процесса по дисциплине приведена в таблице:								
Наименование	Вид занятий	Наименование оборудования,						
специализированных		программного обеспечения						
аудиторий, кабинетов,								
лабораторий								
учебная аудитория для		1. Доска, учебная мебель, проектор						
проведения занятий	Лекции	2. Windows 8 Russian; Windows Professional 8						
лекционного типа: аудитория		Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г.						
415 (физико-технического		Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная.						
корпус учебное)		3. Microsoft Office Standard 2013 Russian.						
		Договор №114 от 12.11.2014 г Лицензия-OLP NL						
		Academic Edition. Бессрочная.						
учебная аудитория для	Лабораторная	1. Вторично-ионный масс-спектрометр «Полюс-						
проведения занятий	работа	4», Полевой электронный спектрометр.						
лабораторного типа: аудитория		2. Windows 8 Russian; Windows Professional 8						
106 (физико-технического		Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г.						
корпус учебное)		Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 3. Microsoft Office Standard 2013 Russian.						
		Договор №114 от 12.11.2014 г Лицензия-OLP NL						
	***************************************	Academic Edition. Бессрочная. 1. Доска, учебная мебель, проектор						
учебная аудитория для	консультация	2. Windows 8 Russian; Windows Professional 8						
консультирования и промежуточной аттестации:		Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г.						
аудитория 415 (физико-		Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная.						
математический корпус учебное		3. Microsoft Office Standard 2013 Russian.						
математи теский корпус у теопос		Договор №114 от 12.11.2014 г Лицензия-OLP NL						
		Academic Edition. Бессрочная.						
помещения для	Самостоятельная	1. Научный и учебный фонд, научная						
самостоятельной работы:	работа	периодика, Wi-Fi доступ для мобильных устройств,						
Читальный зал №2 (корпус	_	неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество						
физмата, 2 этаж).		посадочных мест – 50.						
		2. indows 8 Russian; Windows Professional 8						
		Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г.						
		Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная.						
		3. Microsoft Office Standard 2013 Russian.						
		Договор №114 от 12.11.2014 г Лицензия-OLP NL						
		Academic Edition. Бессрочная.						

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины	«Вакуумная и плазменная электроника»	на	<u>5</u>	семестр
	(наименование дисциплины)			
	очная			
	форма обучения			

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	4/144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	73,2
лекций	36
практических/ семинарских	
лабораторных	36
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды	
учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с	
преподавателем) (ФКР)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	36
Учебных часов на подготовку к	
экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	34,8

Форма контроля:		
экзамен_	5	семестр

№ п.п.	Тема и содержание	пра сем лаб сам тру	ериалов: ктические инарские ораторные остоятель доемкосте	леі зан зан е раб ная рабо	кции, ятия, ятия, боты, ота и	Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельно й работе студентов (СРС)	Форма текущего контроля успеваемост и
		Л К	ПР/СЕ М	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модуль 1. Эмиссионная электроника. Движение электронов в электрических и магнитных полях. Электрон и его свойства. Электроны в металлах. Термоэлектронная эмиссия металлов. Вывод и анализ уравнения Ричардсона-Дэшмана. Простые металлические термокатоды. Влияние адсорбции атомов и молекул на работу выхода электронов из металла. Пленочные термокатоды. Эффект Шоттки. Эмиссия с поверхности полупроводников. Оксидный катод.			4	4	(0),	2(§119,120), 4(5.292, 293, 296, 305).	
2	Фотоэлектронная эмиссия. Основные закономерности, сложные фотокатоды. Фотоэлектронные приборы. Вторичная электронная эмиссия и её применение в приборах. Фотоэлектронные и вторичные электронные умножители. Автоэлектронная эмиссия.			4	4		62,63)	Тест
3	Электронная оптика - основные понятия, сходство и различия световой и электронной оптик. Электронные линзы. Движение электронов в магнитных полях. Магнитные линзы.			2	4	1(§16,17), 3(§13- 15), 5(§3-8).	4(§67,72,75, 77)	
4	Электронно-оптические системы и принципы их построения. Особенности формирования интенсивных пучков. Ионно-оптические системы. Отклонение	4		4	4	1(§16,17), 3(§13- 15), 5(§3-8).	4(§67,72,75, 77)	

	электронов в электрических и магнитных полях. Отклоняющие системы. Принципы построения и работы электронно-лучевых приборов.							
5	Движение электронов в режиме объемного заряда. Вывод уравнения "трех вторых". Вольт-амперная характеристика вакуумного диода. Физические основы работы вакуумных триодов, тетродов, пентодов. Особенности движения электронов в СВЧ-полях. Наведённые токи. Физические основы работы клистронов, ламп бегущей волны, магнетронов	4	4	ı	6		6(§23), 4(§6.80,81,84,85)	Тест
8	Модуль 2. Элементы газоразрядной электроники. Газоразрядные приборы. Движение электронов в газах. Столкновения. Элементарные процессы при столкновениях электронов с атомами и молекулами. Несамостоятельный разряд и его применение в приборах. Пробой разрядного промежутка. Закон Пашина.		4	ı		1 (§30,31), 3 (§21,22), 5 (§12, 15, 20)	4(6.122,124)	
9	Тлеющий разряд. Феноменологическое описание. Теория катодных областей разряда. Приборы тлеющего разряда. Физические основы дугового и искрового разряда. ВЧ и СВЧ разряды. Коронный разряд. Применение разрядов.		2	2		3(§21,23), 5(§21,27), 1(§33,34)	4 (6.105, 107, 111)	КР
10	Плазма - основные понятия. Параметры плазмы и их определение. Диффузионная теория плазмы. Особенности теории плазмы низкого и высокого давлений. Излучение плазмы и его применение в приборах. Газоразрядные индикаторные панели.		4	1		1(§37,39), 5(§25,30)	4(6.154, 156,160)	
	Всего часов:	36	36	6	70,8			

Примечание 1. Сокращение в таблице: КР – контрольная работа. **Примечание 3.** Часы на самостоятельную работу включают время на подготовку к экзамену (контроль).

Рейтинг – план дисциплины

«Вакуумная и плазменная электроника»

(название дисциплины согласно рабочему учебному плану) Направление «Электроника и наноэлектроника», профиль «Электронные приборы и устройства»

курс <u>3</u>, семестр <u>5</u>

Виды учебной деятельности	Балл за	Число	Бал	ЛЫ
студентов	конкретное заданий за		Мини-	Макси-
	задание	семестр	мальный	мальный
Модуль	1			
Текущий контроль				
Тест 1	2	8	0	16
Выполнение и защита отчета по	4	1	0	4
лабораторным работам				
Рубежный контроль				
Контрольная работа №1	5	3	0	15
ВСЕГО ПО МО	ДУЛЮ 1		0	35
Модуль 2				
Текущий контроль				
Тест 2	2	8	0	20
Выполнение и защита отчета по	4	1	0	4
лабораторным работам				
Рубежный контроль				
Контрольная работа №2	5	3	0	15
ВСЕГО ПО МО	ДУЛЮ 2		0	35
Поощрительнь	іе баллы			
Участие в конференциях, публикация			0	10
статей				
Итого поощрительных баллов		•	0	10
Посещаемость (баллы вычи	таются из общей (суммы набр	анных балл	ов)
Посещение лекционных занятий			0	-6
Посещение практических занятий			0	-10
Итоговый ко	нтроль			
Экзамен	9 (вопрос билета)	2 вопроса	Макс. 18 б.	30
	3 (доп. вопрос)	2	Макс. 6 б.]
	6 (задача)	1	Макс. 6 б.	

Форма экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 По дисциплина <u>Вакуумная и плазменная электроника</u>

- 1. Вакуум, степени вакуума, основной критерий степени.
- 2. Условие возникновения самостоятельного разряда.

Заведующий кафедрой / Салихов Р.Б./